知能機械工学科 山田研究室

0014102 渡邉まゆ

§1.序論

筆者ら1.2は、微細加工技術を応用し、微小熱電対プローブを 開発し、そのプローブによる細胞のリアルタイム熱計測の実現を目 指している。微小熱電対プローブは、マイクロピペットと呼ばれる針 状微細管に2種の金属薄膜を積層させ、熱電対閉回路を実現 するという方法で、開発を進めている。その中で、積層させる金属 薄膜間の絶縁膜は非常に重要である。

そこで本研究では、その絶縁膜として DLC(Diamond-Like Carbon)膜の利用を検討し、マイクロピペットへのコーティング技術 の開発を行った。

DLC は炭素からなるアモルファス構造体であり、ダイヤモンドとグ ラファイトの特性を兼ね備えた炭素系材料ある。高硬度や、低摩 擦係数、化学的安定性、生体親和性、高電気抵抗率など、他 の材料では得られない多くの特性を持つため、幅広い分野での研 究・利用が進められており、特に機械分野では潤滑膜³として、生 体工学分野では抗血栓皮膜4として、半導体分野では絶縁膜5と しての研究が盛んである。これらの DLC 製膜技術は、基本的に平 基板もしくは滑らかな曲面が対象でとされてきた。そのため、平基 板を前提とした装置のままでは、マイクロピペットのような、微小かつ 立体的な構造物への製膜は一般に難しく、電極構造や印加電 圧に工夫が必要である。

§2.製膜方法

2.1 製膜対象

マイクロピペットとは、先端径が 0.1~10µm の針状のガラス管 であり、細胞工学や医療などの分野において、単細胞のピックアッ プや、細胞内部に特定のタンパク質や DNA などをインジェクション するための注入針として、また、パッチクランプ法のパッチ電極の基 材として用いられている。微小熱電対プローブの基材にマイクロピ ペットを用いる利点は、以上のように、温度測定と同時に種々の 細胞操作を行えることにある。また、マイクロピペットの作製は比較 的容易で、作製条件により先端径を変更することが可能であるこ



図1 DLCコーティングされた試料の構造

とである。

ここでは、マイクロピペット製作器(PC-10, Narishige)を用い、表 面の汚れを除去するためにあらかじめ、アセトンに浸漬させ、充分 に乾燥させたガラス管(G-1,Narishige;外径 1.0mm,内径 0.6mm, 長さ 90mm)から先端径約 5 µ m、全長約 50mm のマイクロピペッ トを作製した。

次に、マイクロピペットの表面に金属薄膜をスパッタ装置により、 50nm 程度堆積させた。 すなわち製膜対象は、 微小熱電対プロー ブの回路をなす金属薄膜であり、その金属には、DLC 膜との密着 性に優れた材質を選択するようにした。それには、炭化物を生成 する物質あるいは炭化物を採用することが最適であるとされる7。そ のため、炭化物を生成する主な金属(もしくは合金)とその熱電能 を調べ、検討した。その結果、白金(Pt)とアルミ(AI)などを熱電対 用金属とし、各々の金属がコートされたマイクロピペット(以下試料 と呼ぶ)に DLC 製膜実験を行い、図1に示すような構造の DLC が コーティングされた試料の作製を目指した。

2.2使用装置

製膜実験には、本学・電子工学科奥山研究室所有の内部 電極・容量結合型高周波(RF)放電プラズマCVD装置を用いた。 電極構造は、図2に示すような試料が直接カソード電極と接続さ れた構造とした。そのため、放電時試料表面は自己バイアス効果 により負電位になり、この負電位による原料ガス CH4 の表面反応 で DLC 薄膜が形成される。

また、テフロン板により、カソード電極から試料以外への抵抗を 高くし、積極的に自己バイアス効果を利用することで、同じ印加 電圧でも短時間で厚い膜が得られるようにしている。

プラズマを試料周辺で効率よく発生させるため、アノード電極と して円筒形電極を試料がその中心になるように設置した。その円 筒形電極は、均質なプラズマを得るために、内部への安定したガ ス供給が可能な、メッシュ形状とした。

この電極の使用により、DLC製膜時に、プラズマが完全に円筒



表 1 DLC 製膜条件

電極構造	
メッシュ円筒状電極	
AI または Pt コートされたマイクロピペット(試料)	
製膜条件	
CH ₄ ;10sccm, He;10sccm	
25Pa	
110 ~ 120V	
30~60 s	

内に閉じこめられているのメッシュを通してを観測することができた。 円筒刑電極の径は試料に対して相対的に大きいと、放電ができ なかったり、プラズマ密度が薄くなったり、また、小さいと電極内のプ ラズマが均一にならない、といった問題があり、現在 40mmの円 筒型メッシュ電極が最適と判断し、使用している。

その結果、試料の根元から径が小さくなり始める領域に製膜されたDLC膜は良好であったが、先端2mm程度から先の領域に関しては、箔状の膜や、剥離して針状になったものが観察された。これは、試料の構造上、先端部に電荷が集中することで、チャージアップや温度上昇が起こり、膜が剥離してしまうためであると考えられる。それを避けるための試行とその結果を次節で述べる。

2.3製膜電圧制御

試料先端は構造上、 1mm の管部から先端径は 約5μm と急激に細くなっている為、製膜中のプラズマ加速電圧の集中も 急激に先端表面で起こっていることが考えられる。そのため、製膜 電圧を極力低下させ、また、製膜時間を短縮し、試料先端への 電気的負荷の低減を図り、実験を行った。

その結果、設定製膜電圧の低下や、製膜時間の短縮に従って、 次第に剥離の程度は治っていった。しかし、製膜時間の短縮によ る膜厚の低下は避けられないため、短時間の製膜を繰り返し行う ことにした。

しかし、断続製膜を行う為には、その一回の製膜ごとにプラズマ 放電を繰り返し行わなければならず、そのためには製膜電圧の約 5~6 倍である、絶縁破壊のための放電を行う必要がある。そのた め、高周波電源を制御することによる放電の自動制御を試みた。 それにより、迅速で確実な電源操作が行えるようになり、剥離の 起こらない条件出しが容易になった。

最終的な DLC 製膜条件は表 1 のようになった。

§3.DLC 膜の評価

3.1ラマン分光法

ラマン分光法⁸は、光の散乱現象であるラマン効果を応用して 得られたラマンスペクトルを用い、物質の評価を行う方法であり、 構造によって大きく物性が変化する炭素材料の同定方法として 一般的である。具体的には、得られたラマンスペクトルをピーク分 離し、同定を行うが、DLCではDLCに特有のグラファイト構造によ る 1550cm⁻¹付近の G(Graphite)ピーク、乱れたグラファイト構造に よる 1330cm⁻¹付近の D(Disordered)ピークを用いる⁹。

マイクロピペット上の DLC 膜のラマン分光測定には今回至らな かったが、同装置で製膜した Si 基板上の DLC 膜のラマンスペクト ルを本学・量子物質工学科阿部研究室の協力で測定した(図 3)

1550 cm⁻¹付近のGピーク、1390cm⁻¹付近のDピークの合成スペクトルになっていると思われる。

3.2DLC の抵抗値測定

DLC は高抵抗の絶縁膜であり、一般に 10⁹~10¹⁴・cm の電 気抵抗率をもっているとされている。

マイクロピペット上に製膜された DLC 膜を測定した結果、抵抗 率は1.8×10¹⁴・cmと、妥当な値が得られ、DLC 膜が絶縁膜と して機能していることが確認された。



§4.結論

本研究では、微小熱電対プローブの絶縁膜への適用を目指し、 マイクロピペットへの DLC コーティング技術の開発を行った。

- その結果、以下の結論を得た。
- 製膜には、内部電極容量結合型高周(RF)波プラズマ CVD 装置を用い、メッシュ円筒形電極構造を開発した。また、製膜対象のマイクロピペットに金属をコートし、それを直 接カソード電極とすることで、試料周りに均質なプラズマを効 率的に発生させることができた。
- 2) 下地金属によって、DLCの膜質に違いがあることがわかり、 密着性向上と、熱電対使用金属の熱起電力を考慮し、下 地金属を検討した。その結果、Pt 試料とAI 試料へ DLC 製 膜実験を行った。試料上に製膜された DLC の膜質は良好 であったが、微細な先端に関しては、剥離が観察された。
- 3) 先端部の剥離を回避するために、設定製膜電圧の低下や、製膜時間短縮を行い、試料先端への電気的負荷の低減をはかった。その結果剥離状況は改善されたが、製膜時間の短縮による膜厚の低下がみられた。
- 4) 3)の短時間製膜を繰り返し行うために、電圧の自動制御 を行った。それにより、断続製膜の作業が簡略化され、繰り 返し回数の設定で、従来の方法より厚い DLC 膜を得ること ができるようになった。

¹角田直人 他:生体微小領域熱計測のための熱電対プローブの 試作,伝熱シンポジウム講演論文集 (2001) ²今井友香:平成 15 年度修士論文 細胞レベルの熱計測技術

(2004)

³角谷透:DLC 膜の塑性加工工具への適用,トライボロジスト,**47**,821,(2002)

⁴A. C. Evans, J. Franks, P. J. Revell: "Diamond-like carbon applied to bioengineering materials" Surface and Coating Technology, **47** 662 (1991)

⁵E.Ohta et al: "MIM Switching Device Using Diamond-Like Carbon Films", Extended Abstracts of 22nd Conference on Solid State devices and Materials, Sendai, 589, (1990) ⁶岡田泰伸 『新パッチクランプ実験技術法』吉岡書店(2001) ⁷赤里孝一郎:DLC 膜の密着性向上技術,トライボロジス ト,**47**,809,(2002)

⁸北川禎三,Anthony.T.Tu[®]ラマン分光学入門』化学同人(1998) ⁹J.Schwan et.al:"Raman spectroscopy on amorphous carbon films" Journal of Applied Physics Vol.**80** 440 (1996)